

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Вятский государственный университет»
(ВятГУ)

П Р И К А З

22 февраля 2024 года

№ 102 -ТД

г. К и р о в

Об утверждении Прейскуранта на платные услуги, оказываемые научно-образовательным центром по направлению «Нанотехнологии»

В соответствии с пунктами 2.6 и 4.1 устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Вятский государственный университет» в связи с актуализацией цен и изменением перечня платных услуг, оказываемых научно-образовательным центром по направлению «Нанотехнологии», на основании утвержденных калькуляций стоимости услуг п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.03.2024 Прейскурант на услуги, оказываемые научно-образовательным центром по направлению «Нанотехнологии» (Приложение).
2. Признать утратившим силу приказ от 25.12.2018 № 1121 «Об утверждении Прейскуранта на платные услуги, оказываемые Научно-образовательным центром по направлению «Нанотехнологии»».
3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера – руководителя Департамента экономики и финансов Пересторонина С.А.

Ректор

В.Н. Пугач

Приложение
к приказу ВятГУ
от 22.02.2024 № 102-ТД

ПРЕЙСКУРАНТ
на платные услуги, оказываемые научно-образовательным центром
по направлению «Нанотехнологии»

№п/п	Наименование услуги	Условия оказания услуги	Стоимость услуги, в т.ч. НДС (20%), руб.
1.	Качественный рентгенофазовый анализ поликристаллических образцов	Порошковый дифрактометр XRD-7000, Shimadzu. Мелкокристаллический порошок (массой не менее 1 г) или плоский металлический шлиф диаметром 20 мм (толщиной 2 мм)	2450,00
2.	Оптическая микроскопия	Стереомикроскоп SMZ-1500, Nikon. Визуализация объектов в проходящем и падающем свете с увеличением до x 100, определение геометрических параметров, получение микрофотографий. Максимальный размер объектов 100 x 100 x 50 мм	800,00
3.	Растровая электронная микроскопия поверхности образца (РЭМ).	Микроскоп JSM-6510 LV, JEOL. Исследование топографии поверхности образца, морфометрия структурных единиц в условиях высокого вакуума с детекцией вторичных или отраженных электронов (до 10 микрофотографий). Максимальный размер образца 55 x 55 x 20 мм. Для образцов с низкой электропроводимостью требуется пробоподготовка с напылением токопроводящего слоя	2300,00
4.	Статистический анализ размеров структурных элементов по данным РЭМ, ПЭМ или оптической микроскопии	-	1500,00
5.	Анализ элементного состава приповерхностного слоя образца методом электронно-зондового микроанализа (РСМА, ЭДС)	Энергодисперсионный спектрометр Inca X-MAX, Oxford Instruments, на базе микроскопа JSM-6510 LV, JEOL. Анализ элементного состава выделенных областей (до 5 участков) образца.	1470,00

		Максимальный размер образца 55 x 55 x 20 мм	
6.	Элементное картирование поверхности образца методом электронно-зондового микроанализа (РСМА, ЭДС)	Энергодисперсионный спектрометр Inca X-MAX, Oxford Instruments , на базе микроскопа JSM-6510 LV, JEOL . Картирование элементного состава по поверхности образца (не более 30 мин. на образец). Максимальный размер образца 55 x 55 x 20 мм	2700,00
8.	Зондовая микроскопия поверхности образца (АСМ)	Микроскоп Ntegra Prima, NT-MDT . Исследование топографии поверхности образца методом атомно-силовой микроскопии в контактном/полуконтактном режиме (высотный, фазовый, амплитудный контраст). Изучение рельефа в субмикронном диапазоне стандартными зондами. Максимальная область сканирования до 100 x 100 мкм. Максимальный размер образца 30 x 30 x 15 мм, вес не более 30 г, высота рельефа менее 1 – 3 мкм	3700,00
9.	Просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ)	Микроскоп ЖЕМ-2100, JEOL . Исследование морфологии микро- и нанообъектов (до 10 микрофотографий). Анализ сухой пробы либо высушенной капли раствора, предварительная фиксация биологического материала	3100,00
10.	Механическая прецизионная подготовка поверхности образцов	Максимальный размер заготовки 8 x 8 x 20 мм	1700,00
11.	Вакуумное напыление углерода	Пробоподготовка для ПЭМ и СЭМ (установка ЖЕЕ-420, JEOL)	900,00
12.	Вакуумное напыление металла	Пробоподготовка для РЭМ (установка ЖФС-1600, JEOL). Вакуумное напыление токопроводящего слоя толщиной до 30 нм	900,00
13.	Приготовление тонких срезов полимерных материалов	Микротом-криостат НМ 525, Carl Zeiss . Размер образца не более 5 x 5 x 20 мм	700,00